# 精密加工へ用いる時空間波形歪が補償された 超短パルスビームアレイの生成法に関する研究

東洋大学 理工学部 機械工学科 教授 尼子 淳 (平成 29 年度 一般研究開発助成 AF-2017215)

キーワード: 超短パルスレーザー, ビームアレイ, 回折光学

## 1. 研究の背景と目的

超短パルスレーザーを用いた精密加工の技術が注目 されている[1-3]。この技術が広く産業へ応用されるに は、製造に求められる加工精度と生産性が同時に満足 されなければならない。超短パルスの非熱特性を利用 すれば金属からガラスまで様々な材料を高精度に加工 できる。一方で超短パルス光源の高出力化が進み、パ ルスビームを分岐して材料の複数部位を並列に加工す れば、パルスエネルギーは無駄にならず、加工スルー プットは上がる。レーザービームを分岐する手段とし ては回折ビームスプリッタが簡便であり、ナノ秒パル スレーザーを用いた加工では量産技術として実用化さ れている[4]。こうした背景から、回折ビームスプリッ タを応用した超短パルスビームアレイの生成法に関す る研究が関心を集めている。

しかし、超短パルスビームを回折ビームスプリッ タに通すとやっかいな問題がおこる。パルスの波長 帯域が広いため、回折されたパルスの波形は時空間 で歪んでしまう。図1に示すように、回折で生じる 色収差によりパルスビームの空間強度分布が歪む。 時間軸でながめると、色収差のせいでパルスのスペ クトル幅が狭くなり、パルスは伸びる。その結果、 加工スループットを左右するビームアレイの長さは 制限される。~100fs 程度のパルスの場合、光軸近傍 のごく狭い領域にビームアレイをつくれば、パルス 波形歪の加工への影響は小さい[5-9]。が、加工用途 は限られる。ビームアレイを拡大する方法が研究さ れてきたが、パルス波形歪はとりきれていない [10-12]。回折ビームスプリッタの後ろに屈折レンズ



図1 回折ビームスプリッタで分岐された超短パ ルスビームに生じる時空間の波形歪.

と二枚の回折レンズを置いたトリプレット光学系が Minguez-Vega らにより提案されている。しかし、パ ルス波形歪が補償される回折角は小さく、回折角 1.6°でパルスは28 fs から 63 fs まで伸びる、との実 験結果が報告されている[13, 14]。

本研究では、超短パルスレーザー加工への応用を めざし、時空間の波形歪が補償された超短パルスビ ームアレイをつくる光学系を開発する。実用には数 本から数十本のビームを数 mm の長さで並べれば足 りる。光学系の設計と評価には時間幅 20 fs のパルス を用いる。非熱特性を利用するにはパルスは短いほ うが有利であるが[3]、パルス品質の安定性にも配慮 が要る。パルス波形を歪せるふたつの要因一色収差 と分散一をいかに除くかが開発の鍵となる。

## 2. ビームアレイ生成の考え方

図2に、われわれが提案するビームアレイ生成光 学系の構成を示す[15, 16]。光学系の前段は回折ビー ムスプリッタ(DBS)と回折集光レンズ(DFL)から成る 回折系であり、ここでビームアレイの横色収差を補 正する。後段は一対のハイブリッドレンズ(HL1, HL2) から成るアフォーカル系であり、前段で発生した縦 色収差を補正し、さらにレンズ形状を反映した不要 なパルスの伸び(パルスフロント歪)を補償する。 レンズ形状に依らないパルスの伸びについては、チ ャープミラー対でパルスに逆符号の伸びを与えて相 殺する。回折ビームスプリッタで生じる角分散は必 要に応じて位相差板(PP)で補償する。図中、F1は中間 の集光面、F2は最終の集光面(加工エリア)である。 集光面 F2で、時空間の波形歪が補償された超短パル スビームアレイが得られる。

上記のハイブリッドレンズは正の焦点距離をもつ 屈折レンズと負の焦点距離をもつ回折レンズから成 る。前者は主にビームの伝搬方向を決め、後者は主 にアフォーカル系の分散を調整する。屈折レンズと 回折レンズでは、1) 色収差の正負が反対であり[17]、 2) 位相波面に対するパルス波面の進み遅れの関係も 逆になる[18]。この性質を利用すれば、ビームアレイ



図 2 提案する超短パルスビームアレイ生成光学系の構成. DBS: 回折ビームスプリッタ, DFL: 回折集光レ ンズ, PP: 位相差板, HL<sub>1</sub>, HL<sub>2</sub>: ハイブリッドレンズ.

生成光学系の色収差補正と分散補償を同時に行い、 パルスフロント歪も除くことができる。

当初発案した光学系のプロトタイプでは、アフォ ーカル系を高分散ガラスから成る屈折単レンズで構 成していた。われわれはこのプロトタイプを用いて 色収差補正と分散補償の原理を20fsパルスで検証し、 ビームアレイの長さを制限する要因について調べた [19, 20]。しかし、プロトタイプにはビーム半径の二 乗に比例して増えるパルスフロント歪が残っていた ため、光学系の空間分解能が制約されていた。パル スフロント歪は屈折レンズだけではとりきれず、屈 折レンズと回折レンズを組み合せたハイブリッドレ ンズの導入が不可欠である。

## 3. 色収差補正と分散補償の定式化

ビームアレイ生成光学系の設計に用いる以下の式 を導出した。式(1)は横色収差Δy を与える式、式(2) は縦色収差Δz を与える式、そして式(3)はパルスフロ ント歪Δr を与える式である。式(1)と(2)の導出には光 線行列[21]を、式(3)の導出にはパルス伝搬の解析モデ ル[22]を用いた。近軸領域の仮定の下で、集光面 F2 におけるビーム位置とパルスの伸びをそれぞれ波長 で級数展開し、一次近似により式を導いた。これら の式は、光軸上を伝搬するビームに加え、光軸外に 回折されたビームに対しても成立する。

$$\Delta y = [f_{d0} - s] \frac{u_0}{\lambda_0} \Delta \lambda \tag{1}$$

$$\Delta z = \left[ -\frac{f_{d0}}{\lambda_0} + 2\frac{dF}{d\lambda} \right] \Delta \lambda \tag{2}$$

$$\Delta \tau = \left[ -\frac{f_{d0}}{\lambda_0} + 2\frac{dF}{d\lambda} + 2\lambda_0 \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{dF}{d\lambda}\right) - 4\frac{\lambda_0}{F_0} \left(\frac{dF}{d\lambda}\right)^2 \right] \frac{R^2}{2cF_0^2} \Delta \lambda \quad (3)$$

回折系の設計には式(1)を用いる。式(1)で、 $\lambda_0$  はパ ルスの中心波長、 $\Delta\lambda$  はパルスの波長帯域幅(半値全 幅)、 $f_{a0}$  は $\lambda_0$  に対する回折レンズの焦点距離、u0 は回 折角、s はスプリッタと回折レンズの距離である。式 (1)から、 $s = f_{a0}$  の条件で $\Delta y = 0$  となり、横色収差が消 える。中間の集光面 F<sub>1</sub> においては、回折角によらず、 集光パルスビームは等しい縦色収差をもつ。この空 間的並列性により後段のアフォーカル系でビームア レイの縦色収差を消すことが可能となる。

アフォーカル系の設計には式(2)と(3)を用いて、Δz =0  $\delta_{\tau}$ =0 が同時に満足されるように、レンズパラ メータを決める。式中、Foは Au に対するハイブリッ ドレンズの焦点距離、R はアフォーカル系でのビー ム半径、そして c は真空中の光速である。微分係数 は λoにおける値である。屈折レンズと回折レンズの 焦点距離をそれぞれ fi(\lambda)、f2(λ)とするとき、薄肉レン ズで近似すれば、 $F = f_1 f_2 / (f_1 + f_2)$ である。ただし  $f_1(\lambda) = f_{10}[n(\lambda_0)-1]/[n(\lambda)-1], f_2(\lambda) = f_{20}\lambda_0/\lambda と与えられる。$ 添え字の 0 は中心波長 λωにおけるレンズの焦点距離 を意味する。設計のパラメータに fio を選ぶと、Δz=0 となる $f_{10}$ と $\Delta \tau = 0$ となる $f_{10}$ の間にはわずかな差が生 じる。この差をなくすには、屈折率の分散が小さい (アッベ数が大きい)ガラスを選ぶ必要がある。屈 折レンズと回折レンズは同種のガラスでも異種のガ ラスでもよい。本研究では色収差の補正を優先し、  $\Delta z = 0$ となる fuoの値に対して、あらかじめ設定した Foからf2oを決める。ハイブリッドレンズの導入によ り光学系の設計の自由度は格段に広がる。

光学系に入力するパルスを時間幅 to (半値全幅) のガウス型パルスと仮定すると、集光面 F2における パルス幅は $\tau = \sqrt{\tau_0^2 + \Delta \tau^2}$  で見積もれる。式(3)からわ かるように、パルスフロント歪 $\Delta \tau$  は入力パルスの波 長帯域幅 $\Delta \lambda$ に比例する、すなわち、時間幅 toに反比 例する。このためにパルス幅が狭くなるほどパルス フロント歪は顕著に現れる。



図3 色収差と波長の関係(計算値):実線はハイ ブリッドレンズ,破線は屈折単レンズ.



図 4 パルスフロント歪とビーム半径の関係(計 算値):実線はパルス幅 20 fs,破線は 100 fs.

# 4. 光学系の設計と製作

中心波長 780 nm、パルス幅 20 fs(波長帯域幅 46 nm) のガウス型パルスを評価に使うことを前提に、先に 導出した諸式を用いて光学系を設計・製作した。

まず、回折集光レンズの焦点距離を  $f_{40} = 50 \text{ mm}$ として、式(1)から回折ビームスプリッタと回折集光レンズの距離を s = 50 mm と定めた。評価に使うパルス 光源の出力に制約があるため、スプリッタでビーム アレイをつくる代わりに、ブレーズ回折格子がつく る+1 次回折ビームを用いた。回折角の条件を 1.7° と 2.9°に選び、集光面 F<sub>1</sub> 及び F<sub>2</sub>における光軸から のビーム高さをそれぞれ 1.5 mm と 2.5 mm に定めた。 回折格子と回折集光レンズは、断面形状をブレーズ 化して、厚み 1.0 mm の石英ガラス基板上にフォトリ ソグラフィで製作した。どちらも回折効率は 90%を 超え、波長や偏光には影響されない。そのため、波



図5 ハイブリッドレンズの(a) 構造と(b) 外観.

長スペクトルの狭帯域化によりパルス幅が不要に広 がることはない。

ハイブリッドレンズの基本構造を設計するにあた り、屈折レンズと回折レンズの材料には石英ガラス (アッベ数 69)を選んだ。ハイブリッドレンズの焦 点距離を F0 = 150 mm とすると、式(2)から fi0 = 133 mmのときに色収差が除かれ( $\Delta z = 0$ )、薄肉レンズ の式から f20 = -1144 mm と決まる。入射ビーム径 5.0 mm (2R = 15 mm)を仮定すると、式(3)からパルスフロ ント歪は $\Delta \tau = 5.0$  fs と算出される。光学系の集光面 F<sub>2</sub> におけるパルス幅は $\tau_0 = 20.6 \text{ fs}$ と見積もれるので、 ほとんど広がらないことがわかる。設計したハイブ リッドレンズの実効的アッベ数は18である。分散が 小さい石英ガラスをレンズ材料に使っても、回折面 の作用により大きな色収差を補正できる。光学系の 長さもプロトタイプの半分程度になる。設計した基 本構造には後述する製作方法を考慮した微修正が必 要となる。修正後のハイブリッドレンズの焦点距離 は F<sub>0</sub>=150.3 mm、屈折レンズの焦点距離は f<sub>10</sub>=132.2 mm、回折レンズの焦点距離は f20 = -1062.2 mm であ る。修正の前後でハイブリッドレンズの色収差特性 に差がないことを確認している。

図3に光線行列を用いて計算した縦色収差と波長の関係を示す。ハイブリッドレンズを用いると、波長780 nm を中心に広い波長帯域で、パルスの集光位置は波長に対してほぼ不感になる。比較のために図示した石英ガラスから成る屈折単レンズでは大きな色収差が生じている。図4に式(3)を用いて計算したパルスフロント歪とビーム半径の関係を示す。ハイブリッドレンズを用いた場合、パルスフロント歪はプロトタイプの場合の1/8まで小さくなる。比較のために図示した100 fs パルスに対しては、歪はさらに小さい。図3と図4に示した結果は、製作に用いたレンズ仕様をもとに計算したものである。

ハイブリッドレンズの製作では、屈折レンズと回 折レンズは別々に用意して、空気ギャップを介して 鏡筒に組み込むことにした。屈折レンズは平凸レン ズとし、回折レンズは平板上に形成した。屈折レン ズの直径は40 mm、中心厚は5.93 mm、空気ギャッ



図 6 集光面 F<sub>2</sub>の近傍における集光ビーム幅: 回折角 θ<sub>d</sub>の条件は 0.0°, 1.7°, 2.9°.

プは 0.10 mm と定めた。ギャップを設けることでガ ラスと空気の界面が増えるが、これらを含む全ての 界面に反射防止コートを付けて反射迷光を防止し、 光利用効率を高めた。レンズの材料と厚みも考慮し て、チャープミラー対で与えるプリチャープを-850 fs<sup>2</sup>と設定した。図 5 に、製作したハイブリッドレン ズの構造と外観を示す。

## 5. 光学系の評価

用意したブレーズ回折格子、回折集光レンズ、そ して一対のハイブリッドレンズを配置して光学系を 組み上げ、その性能を評価した。繰り返し周波数 80 MHz で動作するカーレンズモード同期チタンサ ファイアレーザー (TFS-1pw NEWFEMTO) を評価に 用いた。パルスの諸元は、パルスエネルギー4nJ、中 心波長 780 nm、パルス幅 22 fs (波長帯域幅 45 nm) である。レーザーから出射された直線偏光パルスビ ームの空間モードはほぼ TEM00 であり、ビーム径は 光学系の入口で 4.2 mm (1/e<sup>2</sup>) である。パルスビー ムの空間強度分布の測定には、高解像 CCD カメラを 装備したビームプロファイラ (SP620U, Ophir-Spiricon) を使った。CCD の感度波長域は 190-1320 nm、画素寸法は 4.4 µm × 4.4 µm である。プ ロファイラは精密微動ステージの上に固定して、測 定の精度と再現性を確保した。パルス波形の計測に はフリンジ分解自己相関干渉計を用い、波形の微細 構造を解像して、わずかな歪でも検出できるように した。干渉計を通過した二本のパルスビームを、位 相整合条件が満足されるように、集光面 F2 に置いた 非線形光学結晶(BBO)へ入れた。BBO から放射さ れた第二高調波をIR 除去フィルタを介してフォトダ イオードへ結像し、出力信号をデジタルオシロスコ



図7 集光面 F<sub>2</sub>で取得したフリンジ分解自己相関 波形. (a) 入力パルス, (b)  $\theta_d = 0.0$  °(光軸上), (c)  $\theta_d = 1.7^\circ$ , (d)  $\theta_d = 2.9^\circ$ , (e) プロトタイプ (光軸上).

ープ (DS-5624A, IWATSU ELECTRIC) により周波数 250Hz でサンプリングして相関波形を取得した。干 渉計の掃引周波数は 0.025 Hz、掃引幅は±50 μm であ る。

## 5・1 集光点におけるビーム幅

集光面 F<sub>2</sub>の前後 ±2.0 mm における集光ビーム幅 の測定値を図 6 に示す。図中、 $\theta_d$ は回折角を表す。ハ イブリッドレンズ HL<sub>2</sub>から遠ざかる向きを測定位置  $\Delta x$ の正の向きと定めた。集光ビームの鉛直方向の幅 を記号( $\bigoplus$ ,  $\blacksquare$ ,  $\blacktriangle$ )で、水平方向(回折される方向) の幅を記号( $\bigcirc$ ,  $\square$ ,  $\triangle$ )で表す。実線は無収差ガウス ビームの計算値である。回折角  $\theta_d = 0.0^\circ$ の条件では、 ブレーズ回折格子を挿入せずに測定した。

回折角  $\theta_d = 0.0^\circ$  ( $\bullet$ ,  $\bigcirc$ ) では、集光ビーム幅が最小 となる位置は鉛直方向と水平方向で一致した。この位 置での最小スポット径は 13 µm であり、ほぼ回折限界 の値が得られた。回折角  $\theta_d = 1.7^\circ$  ( $\blacksquare$ ,  $\Box$ ) では、~0.1 mm の非点隔差が生じ、最小錯乱円の直径は 18 µm で あった。この非点隔差は集光ビームのレイリー長 0.14 mm と比べても短い。したがって、回折角  $\theta_d = 0.0^\circ$ と 1.7°における集光ビームの断面が円形でかつその直径 が等しくなる平面を光軸と直交するように集光面 F2



図8 開発した光学系に時間幅 20 fs のパルスビームを通して得られた集光ビームアレイ.

の近傍に定めることができる。一方、回折角  $\theta_d = 2.9^\circ$ ( $\blacktriangle$ ,  $\triangle$ )では、非点隔差が~0.5 mm まで大きくなり、 最小錯乱円も 30 µm まで拡がった。光軸外の集光ビー ムに生じる非点隔差は、ハイブリッドレンズを構成す る平凸レンズに起因する。

#### 5・2 集光点におけるパルス幅

集光面 F<sub>2</sub> で取得した相関波形を図7に示す。図7(a) は光学系に通す前のパルスの相間波形、図7(b)-(d)は 回折角 $\theta_d$ が0.0°,1.7°,2.9°の条件で光学系にパルスを 通した後で得られた相関波形である。これらの結果は、 集光点でのパルス波形が回折角によらずほぼ同じであ ることを示唆している。相関波形からパルス幅を推定 するために、電場の複素包絡線が次式で表されるガウ ス型パルスを仮定した: $E(t) = E_0 \exp[-(2\ln 2)(1 + ia)t^2/\tau_p^2]$ 。ここで、 $\tau_p$ はパルス幅(半値全幅)、aはチ ャープパラメータである。この式を用いて相関波形を 再現するように $\tau_p$ とaを求めると、回折角 $\theta_d$ によらず、  $\tau_p=22$  fs、a=0.30となった。このことから、集光面 F<sub>2</sub> における集光パルスはほぼフーリエ変換限界であり、 不要な伸びはないと言える。

比較のために、アフォーカル系を一対の屈折単レン ズで構成したプロトタイプから得た相関波形を 図 7(e) に示す。この相関波形を再現するように tp とa を 求めると、tp = 35 fs、a = 1.4 となった。プロトタイプ の相関波形には主ローブの外側に副ローブが認められ る。この副ローブはパルスフロント歪によるものであ り、ハイブリッドレンズを用いた場合は現れていない (図 7(b)-(d))。測定では、波形幅が最小となるように チャープミラーにおけるパルスビームの反射回数を調 整した。屈折単レンズの材料が高分散ガラスのため、 -3400 fs<sup>2</sup>という大きなプリチャープを要した。

以上の結果が示すように、ハイブリッドレンズを用 いて色収差補正と分散補償を行うことにより、ビーム アレイ生成光学系の空間分解能を制限していたパルス フロント歪が除かれる。したがって、光学系の空間分 解能と時間分解能はどちらも限界まで向上する。この ことは時間幅が 20 fs よりも長いパルスビームに対し ては無条件に言える。

#### 5・3 ビームアレイの長さ

前述の評価では、ブレーズ回折格子の+1次回折光 を使い、回折角 θaが 0.0°(光軸上)と 1.7°(光軸外 の高さ 1.5 mm)の条件で、時空間の波形歪がない集光 パルスビームが得られた。ここでは回折ビームスプリ ッタで時間幅 20 fs のパルスビームを分岐してビーム アレイをつくり、波形歪がない集光ビームが並ぶ領域 の広さを詳細に調べる。

図8に、13分岐の回折ビームスプリッタを用いて光 学系の集光面 F2に形成したビームアレイを示す。-13 次から+13次まで、強度に分布はあるが、ほぼ均一な スポット径(18 µm)をもつ 27 本の集光ビームが長さ 3.2 mm にわたり並んでいる。集光ビームの間隔は0.12 mm である。この結果は、開発した光学系を用いれば 1) 少なくとも長さ 3.2 mm のビームアレイをつくれる こと、2) 少なくとも直径 3.2 mm の円の中に縦横に並 ぶビームアレイをつくれること、を意味する。±14次 の外側では、回折角が大きくなるとともに、集光ビー ムの形状は水平方向に少しずつ伸びている。ハイブリ ッドレンズに残る非点収差のせいで、鉛直方向と水平 方向で集光位置がずれるからである。図中、ビームア レイ中央の0次光の強度が突出しているのは、実験に 使用したスプリッタの設計波長 532 nm が超短パルス の中心波長 780 nm からずれているためである。

本研究では一方向にビームを分岐する回折ビームス プリッタを使ったが、縦横二方向にビームを分岐する 回折ビームスプリッタも使える。スプリッタを液晶空 間光変調器に替えれば、表示データの更新だけで、さ まざまな集光ビームパターンを形成できる。

#### 6. 結論

本研究を通じて、時空間の波形歪がない超短パルス ビームアレイをつくる光学系の完成に目途をつけた。 われわれが開発した光学系の特徴は、回折系とアフォ ーカル系をカスケード接続した配置でビームアレイを つくる点、屈折面と回折面を備えたハイブリッドレン ズでパルスフロント歪を補償する点にある。この光学 系を用いれば、実用に足りる長さあるいは広さを有す る超短パルスビームアレイを供給できる。

本研究の成果により超短パルスレーザーを用いたナ ノ・マイクロ加工技術の実用に向けた議論ができるよ うになった。今後は、パルス波長に合わせて設計した 回折ビームスプリッタをビームアレイ生成光学系に装 着し、超短パルス増幅システムを用いたレーザー加工 へ試して、加工精度と生産性の評価を行う予定である。 開発技術の価値はその使いみちで決まると考えており、 産業界のニーズを先取りしつつ、既存プロセスの代用 ではない、付加価値の高い加工用途を開拓したい。

# 謝 辞

本研究は公益財団法人天田財団の平成 29 年度一般 研究開発助成 (AF-2017215) を受けて実施されました。 同財団に深く感謝いたします。

本研究の一部は科学研究費補助金(19K04112)の助 成をいただきました。また、ハイブリッドレンズの製 作には住友電工ハードメタル株式会社の協力をいただ きました。

なお、本研究は本学理工学部電気電子情報工学科の 中野秀俊教授と共同で実施したものである。

#### 参考文献

- B. N. Chichkov, C. Momma, S. Nolte, F. von Alvensleben, and A. Tünnermann, "Femtosecond, picosecond and nanosecond laser ablation of solids," Appl. Phys. A 63, 109–115 (1996).
- X. Liu, D. Du, and G. Mourou, "Laser ablation and micromachining with ultrashort laser pulses," IEEE J. Quantum Electron. 33, 1706–1716 (1997).
- B. Chimier, O. Uteza, N. Sanner, M. Sentis, T. Itina, P. Lassonde, F. Legare, F. Vidal, and J. C. Kieffer, "Damage and ablation threshold of fused-silica in femtosecond regime," Phys. Rev. B 84, 0941041–0941049 (2011).
- J. Amako and E. Fujii, "Beam delivery system with a non-digitized diffractive beam splitter for laser drilling of silicon," Optics and Lasers in Eng. 77, 1–7 (2016).
- Y. Kuroiwa, N. Takeshima, Y. Narita, S. Tanaka, and K. Hirao: "Arbitrary micropatterning method in femtosecond laser microprocessing using diffractive optical elements," Opt. Express 12, 1908–1915 (2004).
- Hayasaki, T. Sugimoto, A. Takita, and N. Nishida, "Variable holographic femtosecond laser processing by use of a spatial light modulator," Appl. Phys. Lett. 87, 031101-031103 (2005).
- L. Kelemen, S. Valkai, and P. Ormos, "Parallel photopolymerisation with complex light patterns generated by diffractive optical elements," Opt. Express 15, 14488–14497 (2007).
- A. Jesacher and M. J. Booth, "Parallel direct laser writing in three dimensions with spatially dependent aberration correction," Opt. Express 18, 21090–21099 (2010).
- M. Sakakura, T. Sawano, Y. Shimotsuma, K. Miura, and K. Hirao, "Fabrication of three-dimensional 1x4 splitter waveguides inside a glass substrate with spatially phase modulated kaser system," Opt. Express 18, 12136–12143 (2010).

- J. Amako, K. Nagasaka, and K. Nishida, "Chromatic-distortion compensation in splitting and focusing of femtosecond pulses by use of a pair of diffractive optical elements," Opt. Lett. 27, 969–971 (2002).
- G. Li, C. Zhou, and E. Dai, "Splitting of femtosecond laser pulses by using a Dammann grating and compensating grating," J. Opt. Soc. Am. A 22, 767–772 (2005).
- S. Hasegawa and Y. Hayasaki, "Dynamic control of spatial wavelength dispersion in holographic femtosecond laser processing," Opt. Lett. 39, 478–481 (2014).
- G. Minguez-Vega, E. Tajahuerce, M. Fernadez-Alonso, V. Climent, J. Lancis, J. Caraquitena, and P. Andres,"Dispersin-compensated beam-splitting of femtosecond light pulses: Wave optics analysis," Opt. Express 15, 278–288 (2007).
- 14) R. Martinez-Cuenca, O. Mendoza-Yero, B. Alonso, I. J. Sola, G. Minguez-Vega, and J. Lancis, "Multibeam second-harmonic generation by spatiotemporal shaping of femtosecond pulses," Opt. Lett. 37, 957–959 (2012).
- 尼子淳,中野秀俊,"アクロマティックカスケード 光学系による時空間波形歪が補償された超短パル スビームアレイの生成," Optics and Photonics Japan 2018, 1aC1 (2018).
- 16) 中野秀俊, 丸尾恵介, 尼子淳, "ハイブリッドレン ズを導入したカスケード光学系による時空間的歪 のないフェムト秒パルスビームアレイ生成,"光 学シンポジウム, 講演番号9 (2020).
- T. Stone and N. George, "Hybrid diffractive-refractive lenses and achromats," Appl. Opt. 27, 2960–2971 (1988).
- Z. Bor, "Distortion of femtosecond laser pulses in lenses," Opt. Lett. 14, 119–121 (1989).
- J. Amako and H. Nakano, "Distortion-compensated multifocusing of ultrashort pulse beams using cascade optical system," Appl. Opt. 57, 33–41 (2018).
- 20) 中野秀俊, 尼子淳, "回折レンズによるフェムト秒 レーザーパルスの光軸外への集光特性,"第79回 応用物理学会秋季学術講演会, 20a-224a-6 (2018).
- A. Yariv and P. Yeh, Optical Waves in Crystals (John Wiley & Sons, 2003), p.34.
- Z. Bor: "Distortion of femtosecond laser pulses in lenses and lens systems," J. Mod. Opt. 35, 1907–1918 (1988).